# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-256500

(43) Date of publication of application: 11.09.2002

(51)IntCL

C25D 17/20 C25D 21/00

(21)Application number: 2001-051495

/74\A\_\_U\_\_\_

(71)Applicant : BEITEKKU JAPAN:KK

(22)Date of filing:

27.02.2001

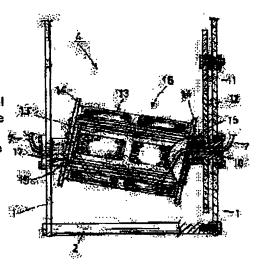
(72)Inventor: DAIWAN TAKASHI

### (54) BARREL PLATING EQUIPMENT

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide barrel plating equipment which effectively prevents contamination of a plating liquid due to damage of a lead wire and has high productivity.

SOLUTION: The barrel plating equipment comprises a barrel which is rotatably supported at both ends by support members via two support axes, a hole at the barrel side for inserting a lead wire therein, which is formed in the barrel, and a hole at the support axis side for inserting the lead wire therein, which communicates with the hole at the barrel side and is formed in the support axis. The size of an open part at the barrel side of the hole at the support axis side is to fit the lead wire. The hole on the barrel side comprises facing to the hole at the support axis side, and has a larger diameter than the open part at the barrel side of the hole at the support axis side, which prevents inflow of workpieces when the lead wire is inserted through the hole at the barrel side.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

http://www19.ipdl.jpo.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAAfTa4iZDA414256500P1.htm

04/01/21

(19)日本国特許庁 (JP)

21/00

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-256500

(P2002-256500A)

(43)公開日 平成14年9月11日(2002.9.11)

(61) Int.CL' C 2 5 D 17/20 **是**附配号

FΙ

g-75-}\*(**多考**)

C 2 5 D 17/20

21/00

K F

春蓮湖水 未離水 諸承項の数3 OL (全 6 頁)

(21)出顯為号

特顧2001--51495(P2001--51495)

(22)川東日

平成19年2月27日(2001.2.27)

(71)出版人 501080217

株式会社ペイテックジャパン

大阪府郭市豊田857番地の1

(72) 発明者 大涛 峻

大阪射射市費田857番地の1 株式会社ペ

イテックジャパン内

(74)代理人 100076406

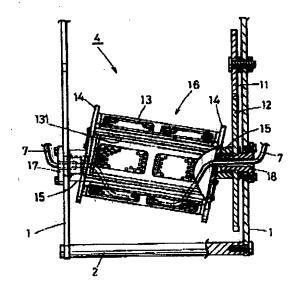
井理士 杉本 勝徳 (外1名)

## (54) 【発明の名称】 パレルメッキ装置

(57)【要約】

[課題] リード線の破損によるメッキ液の汚染を効果的 に防止するとともに、生産性の高いパレルメッキ装置の 提供を目的とする。

【解決手段】本発明のパレルメッキ装置は、パレルを 2本の支持軸を介して両端支持状態で支持部材に回転可能に支持するとともに、パレルに、リード線を押還させるためのバレル側揮通孔を形成し、支持軸に、前記パレル側揮通孔に連通し、リード線を押過させるための支持軸側挿通孔におけるので、支持軸側挿通孔におけるバレル内方側の開放部の大きさを、リード線に審着する人きさとする一方、パレル側押通孔を、支持軸側挿通孔におけるパレルを器内方側の開放部より大径で、パレル側挿通孔におけるパレルを器内方側の開放部より大径で、パレル側挿通孔にリード線を挿過させたときにワークの後入を阻止する大きさとするものである。



(2)

41

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】リークが装填される中空状のパレルと、2 木の支持軸を備える支持部材とを備え、パレルを2本の 支持軸を介して両端支持状態で支持部材に回転可能に支 持するとともに、

パレルに、パレルの外方とパレル内との間に配設するリード線を押通させるためのパレル側押通孔を形成し、支持軸に、前記パレル側押通孔に座通し、パレルの外方とパレル内との間に配数するリード線を押通させるための支持軸側押通孔を形成しており、

支持軸側挿通孔におけるパレル内方側の稠放部の大きさ を、リード線に密着する大きさとする一方、

パレル側挿通孔を、支持軸側挿通孔に対向させるととも に、パレル側挿通孔の大きさを、支持軸側挿通孔におけ るパレル容器内方側の開放部より大径で、パレル側挿通 孔にリード線を挿通させたときにワークの流入を阻止す る大きさとすることを特徴としたパレルメッキ装置。

【請求項2】バレルが、簡体と、バレル側挿通孔を有し 前記簡体の両端開口を覆う側板と、この側板に設けられ 支持軸を回転可能に受け入れる軸受けとを備えており、 前記側板の内面を平面に形成するとともに、

パレルと支持報との間に、支持軸がパレルの側板の内面 よりパレル内方に突出するのを阻止する突出阻止手段を 設けたことを特徴とする論求項1記載のパレルメッキ装 環。

【請求項3】パレルの倒板が、側板本体と、パレル側挿 通孔を有し、側板本体の材質よりも摩擦係数の小さい材 質で形成され、側板本体に若腕可能に取り付けられるリ ード線挿通部材とを備えていることを特徴とする請求項 2記載のパレルメッキ装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えばマイクロチップコンデンサなどのワークにメッキ加工を強すためのバレルメッキ装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来のパレルメッキ装置Yは、図5に示すように、ワークが装填される合成樹脂製の中空状のパレル容器Bと、パレル容器Bに図着され、内部にリード線Rを挿通可能とした挿通孔Dを存する合成樹脂製のリード線文持部材ドとからなるパレルAと、このパレルAを同転輪線(a)を中心に回転自在に支持する図示しない支持部材とを備えて構成されている。リード線支持部材Fは、挿通孔Dの中心がパレル容器Bの回転輪線

(a)上に位置されるとともに、バレル容器Bの外側からパレル容器B内部に突出した状態に嵌合されるポスト 1と、デーバ面を有する難体状に形成された、ボスド 1 の先端部を覆うキャップド 2 とから構成されている。リード線尺は、表面がゴム又は樹脂によって被覆されており、パレルAの外部から挿通孔Dを通してバレル容器B の内部に挿入されている。そして、バレルA全体を回転させることにより、パレルA内に収納されたワークがリード線Rの陰極側電極に電気的に接続してメッキされる。とのとき、伸遠孔Dに神通されたリード線Rは、パレルの回転に運動しないようになっている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、挿通孔Dに リード線Rを挿通させた状態でパレルA全体を回転させ るためには、リード線Rの外径と挿通孔Dの内径との間 **に陰間を設けなければならないが、ワークが例えばマイ** 10 クロチップコンデンサのように敵間よりも小さい厳小な ものである場合には、この隙間にワークが入り込み、挿 通孔Dの内壁面やリード線Rの被覆部が破損したり、バ レルAの円滑な回転を妨害することがあり、良好なメッ キができないという不具合がある。一方、この隙間にワ ークが入り込まないように、リード線Rの外径と挿通孔 11の内径との間に始んど隙間を設けないと、パレルAの 回転に伴ってリード線Rの被覆部が挿通孔Dの内壁面に 接れて破損するという不具合がある。そして、リード線 の被覆部が破損すると、破損により露出したリード級の 20 細部分がメッキ液中に溶出してメッキ液を汚してしまう という不具合がある。さらに、汚れたメッキ液の取り替 えには莫大なコストと手間を要するという不具合もあ る。また、リード線支持部材下は、キャップド2により パレル容器Bの内部に突出した状態となっているため、 谷部にワークが付着しやすく均一なメッキができない場 合があり、また、キャップF2を突出させた分、容積が 小さくなるので、パレル容器Bの内部に収容できるワー クの数量を十分に確保できず、生産効率が悪いという不 30 具合もある。

【0004】本発明は上記問題点に鑑みて提案されたものであって、リード線の破損によるメッキ液の汚染を効果的に防止するとともに、生産性の高いパレルメッキ装置の提供を目的とする。

[0005]

50

【課題を解決するための手段】以上の目的を達成するために、本発明のパレルメッキ装置は、ワークが装填される中空状のパレルと、2本の支持軸を備える支持部材とを備え、パレルを2本の支持軸を介して両端支持状態で支持部材に回転可能に支持するとともに、パレルに、パレルの外方とパレル内との間に配設するリード線を押通させるためのブレル側挿通孔を形成し、支持軸に、内とル側挿通孔に建通し、パレルの外方とパレル内との間に配設するリード線を挿通させるための支持軸側挿通孔を形成しており、支持軸側挿通孔におけるパレル内方側の開放部の大きさを、リード線に符替する大きされているとせるとともに、パレル側挿通孔を、支持軸側挿通孔に対けるパレル内方側の開放部より大径で、パレル側挿通孔にリード線を挿通させたときにワークの流入を阻

30

50

止する大きさとしている。また、パレルが、筒体と、パレル関係通孔を有し前記筒体の両端開口を覆り側板と、この側板に設けられ支持軸を回転可能に受け入れる軸受けとを備えており、前記側板の内面を平面に形成するとともに、パレルと支持軸との間に、支持軸がパレルの側板の内面よりパレル内方に突出するのを阻止する突出阻止手段を設けてもよい。さらに、パレルの側板が、側板本体と、パレル側が通孔を有し、側板本体の材質よりも際源係数の小さい材質で形成され、側板本体に着膜可能に取り付けられるリード線細道部材とを備えたものであ 10ってもよい。

【0008】なお、ワークが例えばマイクロチップコンデンサなど平らで軽いものである場合は、ワークが相互に貼り付いて、メッキムラや厚さのパラツキが人きくなりやすい。そのため、パレルの簡体の中心線を水平面に対して上下方向に10°~12°傾斜させた状態で設けて、攪拌効果を上げることが好ましい。さらに、パレルの傾斜角度を11°とすれば、よりよいメッキを施すことができる。

[0007]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施形態のパレルメッキ装置Xについて詳細に説明する。

【0008】図1は、本実施形態のパレルメッキ装置Xの斜視図である。図2は、パレルメッキ装置Xの部分断面図である。

【0009】本実施形態のパレルメッキ装置Xは、基本的には、図1、図2に示すように、多角筒状のパレルイと、パレル4を回転可能に支持する支持部材3と、支持部材3に取り付けられる駆動装置8と、駆動装置8の動力をパレル4に伝達する動力伝達装置5とを備えている。そして、支持部材3は、左右一対のアクリル製の支持板1と、支持板1に一体に固定され、パレルの軸方向両端側を回転自在に支持する組高密度ポリエチレン製の支持軸17、18と、支持板1同十を連結するアクリル製の連結部材2とから構成されている。なお、このパレルメッキ装置Xは、メッキ構内に浸漬させて用いられる。

【0010】バレル4は、図2に示すように、メッキ液を透過させる多数の孔を設けた多孔板を組み合わせて略六角筒状に形成された箇体13と、この箇体13の両端間口部を覆う側板本体14とからなるパレル本体18と、両方の側板本体14に設けられる軸受けとしての軸受け機構15とを備えた構成となっており、特に指定した部材以外は全てアクリル樹脂で形成されている。また、バレル4は、箇体13の軸方向に延びる中心線が水平面に対して11・傾斜した状態となるように支持部材3に取り付けられている。さらに、箇体13には、截(図示せず)により関止され、ワークの出し入れを行う取納口131が設けられている。

【0011】軸受け機構15は、図3、図4に示すよう

に、内部に貧運孔201、211が形成された四角柱状のボス部20、21と、賃運孔201、2)1の内壁に接着されている超商密度ポリエチレン製の軸受け22とから構成されており、側板本体14に溶着されて、パレル本体16に一体に設けられている。なお、パレル本体16を所定角度傾斜させた状態に支持部材3に取り付けるため、ボス部20、21は、その中心線を側板本体し4に対して所定角度傾斜させて設けられている。

【0012】側板本体14には、貫通孔201, 211 内と連通する連通孔(41が形成されており、この連通 孔141にパレル側挿通孔231を備えた超高密度ポリ エチレン製のプシュ23が取り付けられている。プシュ 23は、劇板本体14の厚さと略同一の厚さの円板状 で、取り付け時に外方への抜けを防止するため、側板本 体14の内面140個の径が大径に形成されている。そ して、側板本体14の内面140と略面―となるよう に、バレル本体 1 B の内方側から着脱可能に嵌合されて いる。なお、パレル側挿通孔231は、後記する支持軸 17、18に設けられたリード線挿通孔174、184 に対向する位置に形成されており、リード線挿通孔 17 20 4. 184におけるパレル4内方側の関放部としての挿 通孔小径部175,185よりも人径で、リード線7を 挿通させたときに、ワークの流入を阻止するように、リ ード線7の外径よりも僅かに入きい径に形成されてい

【0013】支持部材3の支持軸17、18は、軸受け 機器 15 の軸受け22 に挿入される小径部 172. 18 2と、小径部172、182よりも人径の突出阻止手段 としての人径部171、181と、支持部材3の支持板 1化ポルト19により取り付けられるフランジ部17 3、183とから構成されている。なお、一方の文持軸 18の小径部182の軸方向長さは、他方の支持軸17 の小径部172の長さよりも後記するバレルギア12の 厚さだけ長く形成されてむり、ボス21の遊場部には、 バレルギア12がボルト24により取り付けられてい る。また、支持軸17、18の軸中心には、リード線を 挿通させる支持軸側挿通孔としてのリード線挿通孔17 4、184が形成されており、リード線挿通孔174、 184におけるパレル4の内方側の開放部を小径に形成 して挿通孔小径部175、185を設けている。この挿 通孔小径部175,185の人きさは、リード線7を挿 通させたときに、リード線7の外周面が密着するよう に、リード線7とほぼ同径に形成されている。

[0014]リード線7は、表面にゴムが被覆され、先端部に棒状の除極側電極(図示せず)が取り付けられたもので、ワークの収納口131からリード線7を挿入し、陰極側電極と反対側の後端部をバレル本体16の内部からプシュに設けるパレル側挿道孔231に挿通し、さらに支持軸17、18のリード線挿通孔174、184に挿通させた後、バレル4の外部に引き出して、支持

板1に取り付けた陽極側電極6に接続させるようにしている。なお、陰極側の先端部はパレル4内部に挿入されている。

【0015】そして、パレル4を回転させるための駆動 装置8は、パレル4の上方位度で支持部材3に固定され ており、ケース81内に駆動モータと、駆動モータの回 転数を制御する制御装置とが搭載され、駆動モータのオ ンオフを行う電源スイッチ81と、駆動モータの回転数 を調整する操作ツマミ92とを備えている。

【0016】さらに、駆動装置8の動力をパレル4に伝 10 建させる動力伝達装置5は、駆動モータの駆動軸に取り付けられる小径の駆動ギア10と、駆動ギア10から伝達される団転力を後述するパレルギア12に伝達する中間ギア11と、パレル4の一方のボス部21に取り付けられるパレルギア12とから構成されている。そして、駆動装置8を駆動させるととにより、動力伝達装置5の駆動ギア10、中間ギア11、パレルギア12を介して、パレル4が支持軸17、18に支持されながら回転するようになっている。

【0017】以上のように構成されたパレルメッキ装置 20 Xを使用してメッキを行う手順について説明する。

【0018】まず、パレル本体16の収納口131からワークとして約0.3mm径のマイクロチャプコンデンサと、微拌効果を高めるセラミック等の電気的不導体からなる1mm程度の球状のダミーとを所定置投入して、蓋を閉止する。次に、パレル木体16の高さ方向約3分の2程度がメッキ液に浸かるように、パレルメッキ装置 Xをメッキ槽内に設置する。駆動装置の電源スイッチ91をオンすると、動力伝達装置5の駆動ギア10から中間ギア11を介してバレルギア12に回転力が伝達され、パレルギア12を取り付けたパレル4が、軸受け22を介して、支持軸17、18の周囲を回転し始める。なお、パレル本体18の回転速度は、操作ツマミ92により調整する。

【0019】そして、パレル4を回転させながらバレル本体16内のワークを所定時間メッキ浴させた後、バレルメッキ装置Xをメッキ槽から水槽へ移し換え、パレル本体16の蓋を開けて収納口131からワークを取り出して、メッキ工程は終了する。

【0020】以上のように、本実施形態のバレルメッキ 40 装置Xは、支持板1に固定される支持軸17.18に形成される挿通孔小径部175.185をリード線7に密着する大きさとしてリード線7を保持しながら、バレル4側のバレル側伸通孔231の大きさをリード線挿通孔174、184における押通孔小径部175.185よりも大径で、かつ、リード線7を押通させたときに、ワークの流人を阻止するように、リード線7の外径よりも健かに大きい径に形成したので、リード線7とバレル側挿通孔231との間にリークが流入することなくバレル4を回転させることができる。したがって、バレル側挿50

通孔231に神通されるリード線7の被覆部がワークに より破損するのを防止できる。

[0021]また、掃通孔小径部175、185は、リード線7を密答させて保持できるので、リード線7を バレル4の側板木体14に設けるバレル側押通孔231 内に軸中心から位置ズレを少なく押通させることができる。したがって、リード線7の被覆制が、バレル側押通孔231の内壁面に接触したくくなり、リード線押通孔174、184の内壁面に接れることによるリード線7の被覆部の被損を軽減できる。

【0022】また、プシュ23が、側板本体14の厚さと略岡一の厚さに形成されて、側板本体14の内面140と略面一に取り付けられており、また、支持輸17.18には軸受け22に挿入される小径部の後部に人径部171、181が形成されているので、支持輪17、18に支持されたパレル4が軸方向にずれて、支持軸17、18がパレル本体16の内部に突出することがない。したがって、パレル本体16内部に突出御がないので、ワークが一箇所に溜まってしまうこともなく、ワークを均一にメッキすることができ、品質の向上を図ることができる。また、パレル本体16の内容積を最人限確保することができるため、メッキの生産効率の向上を図ることができる。

【0023】さらに、ブシュ23を、耐磨耗性および潤滑性に優れる超高密度ポリエチレンにより形成したので、リード線7の被覆を傷つけにくい。また、ブシュ23は、バレル本体16の内力側から着脱可能に嵌合するものとしたので、例えば、ブシュ23の磨耗により、バレル側伸通孔231の径が大きくなってきた場合などでも、装置全体を解体することなく、バレル4内から簡単にブシュ23を取り替えることができるので、作業性もよい。

[0024]なお、本実施の形態においては、収納したワークに最も良好なメッキを施すため、パレル本体16を、簡体13の軸方向に延びる中心線が水平面に対して11。傾斜した状態となるように支持部材3に取り付けたが、パレル本体16の傾斜角度はこれに限定されることなく、ワークの種類やメッキ液の種類により、最も良好なメッキができる角度にすればよい。

[0025]また、とのメッキ工程は、手動により行うだけでなく、自動制御による流れ作業で行ってもよい。例えば、作業の流れ方向に複数値収容可能な細長いメッキ槽と水槽とを設置してなる協送経路を構成し、メッキ槽へにおいてパレルメッキ装置Xを接送する第1機送手段と、メッキ槽から水槽へ移し変える移動手段と、水槽内においてパレルメッキ装置Xを搬送する第2搬送手段とを設けて、複数台のパレルメッキ装置Xを順次搬送することにより、メッキ処理を、より一層効率よく行うととができる。

[0026]

特開2002 256500

8

[発明の効果] 以上のように本発明のパレルメッキ装置 によれば、ワークが装填される中空状のパレルと、2本 の支持軸を備える支持部材とを備え、パレルを2本の支 持軸を介して両端支持状態で支持部材に回転可能に支持 するとともに、バレルに、パレルの外力をパレル内との 間に配設するリード線を挿通させるためのパレル側挿通 孔を形成し、支持軸に、前記パレル側押通孔に達通し、 バレルの外方とパレル内との間に配設するリード線を挿 通させるための支持軸側挿通孔を形成しており、文持軸 側掃通孔におけるパレル内方側の開放部の大きさを、リ --ド線に密着する大きさとする一方、パレル側挿通孔 を、支持軸側挿通孔に対向させるとともに、バレル側押 通孔の大きさを、支持軸側挿通孔におけるパレル容器内 方側の開放部より大径で、バレル側挿通孔にリード線を **辨道させたときにワークの流入を阻止する大きさとした** ので、バレル側が通孔とこのパレル側挿通孔に挿通され るリード線との間にワークが入り込まないので、バレル 側伸通孔に挿通されるリード線の被覆部がワークにより 破損するのを防止できる。

(0027) また、請求項2に係る発明によれば、パレルが、簡体と、パレル側挿通孔を有し前配簡体の両端開口を覆う側板と、この側板に設けられ支持輪を回転可能に受け入れる軸受けとを備えており、前部側板の内面を平面に形成するとともに、パレルと支持軸との間に、支持軸がパレルの側板の内面よりパレル内方に突出するのを阻止する突出阻止手段を設けているので、パレル内部に突出部がなく、ワークを均一にメッキすることができ、品質の向上を図ることができる。また、パレルの内容積を最大限解保することができるため、メッキの生産効率の向上を図ることができる。

【0028】さらに、結束項3に係る発明によれば、バレルの側板が、側板本体と、パレル側挿通孔を有し、側板本体の材質よりも摩擦係数の小さい材質で形成され、側板本体に若融可能に取り付けられるリード線挿通部材\*

\*とを備えているので、パレル側挿通孔の内壁面がリード線の被痕部に接触してもリード線の被覆部を傷つけにくい。また、パレル側挿通孔に不具合が生じた場合、例えば、リード線を挿通させた際に、パレル側挿通孔とリード線との間にワークが入り込むほどパレル側挿通孔の径が大きすぎた場合などには、リード線挿通部材を取り替えるだけでその不具合が解消されるので利便性に富み、コストもかからない。

【図頭の簡単な説明】

) 【図1】本発明にかかる実施形態のパレルメッキ装置の 斜視図

【図2】同パレルメッキ装置の一部を断面して示す説明 図

【図3】同バレルメッキ装置の要部拡大断面図

【図4】同パレルメッキ装置の要部拡大断面図

【図 5 】従来のパレルメッキ装置の説明図

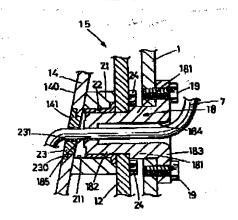
【符号の説明】

231

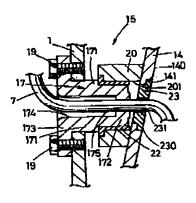
|   | X   | パレルメッキ装置                  |
|---|-----|---------------------------|
|   | 3   | ケーシング(支持部材)               |
|   | 4   | パレル                       |
|   | 7   | リード線                      |
|   | 13  | 角箇体(簡体)                   |
|   | 14  | 側板本体                      |
|   | 15  | 軸受け機構(軸受け)                |
|   | 17  | 支持軸                       |
|   | 18  | 支持軸                       |
|   | 171 | 大怪部(突出阻止手段)               |
|   | 181 | 人径部(突出阻止手段)               |
|   | 174 | リード線押通孔(支持軸側押通孔)          |
| ) | 184 | リード線挿通孔(支持軸側挿通孔)          |
|   | 175 | 挿通孔小径部(バレル内方側の開放部)        |
|   | 185 | <b>挿通孔小径部(バレル内方側の開放部)</b> |
|   | 2 3 | ブシュ(リード線挿通部材)             |
|   |     |                           |

バレル側押通孔

[23]



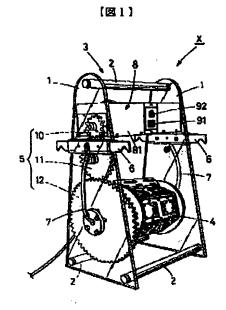
【図4】



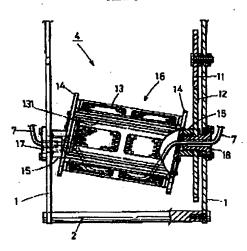
(6)

特別2002-258600

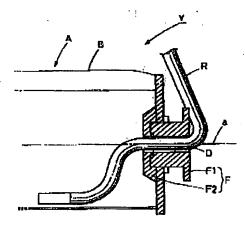




【図2】



[245]



BEST AVAILABLE COPY